

超高解析冷場發射掃描式電子顯微鏡 (HR-FESEM, SU8230)



廠牌：Hitachi 型號：SU8230 (Regulus)

規格：

解析度	0.7nm/1 kV, 0.6nm/15 kV
倍率	x20 to 2,000,000
加速電壓	0.5KV to 30KV(另有減速功能)
電子槍型式	新型冷場發射(CFE)式
樣品最大容許	直徑 150mm x 高度 29mm
試片載台	試片移動範圍: X 軸：0 to 110 mm Y 軸：0 to 110 mm Z 軸：1.5 to 40.0 mm R：360° Tilt：-5 to +70°

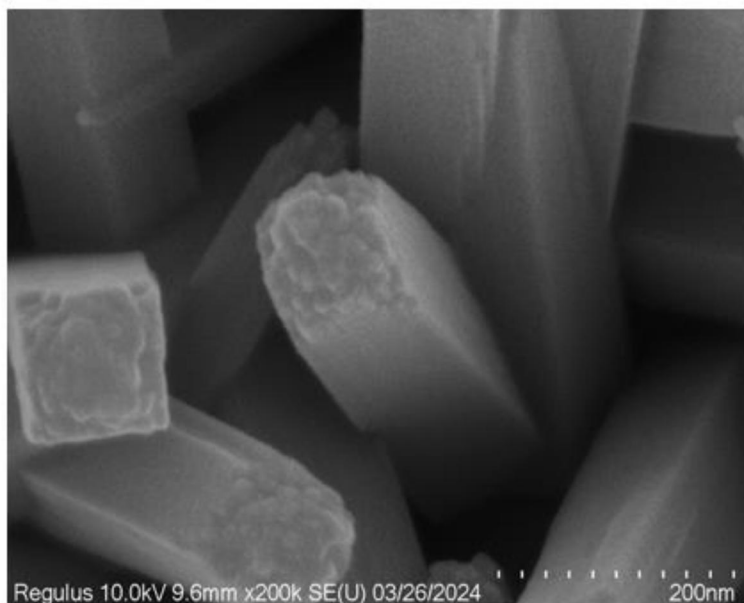
放置地點：成大化工系館 1F 93125 室

其特點為新型冷場發射(CFE)電子槍可提供更明亮的低電壓高解析影像以及更穩定的元素分析。針對低電壓，高分辨率成像進行優化，使得低加速電壓條件下兼備高解析度和分析的最佳性能。在低加速電壓下適合熱敏感樣品之分析，亦可獲得高解析品質之影像。且能提供金屬材料、電子材料及高分子材料等於高倍率下之表面型態觀察。本機台同時配置有能量分散光譜儀(EDS)能做元素成分之定性及半定量分析之工作。

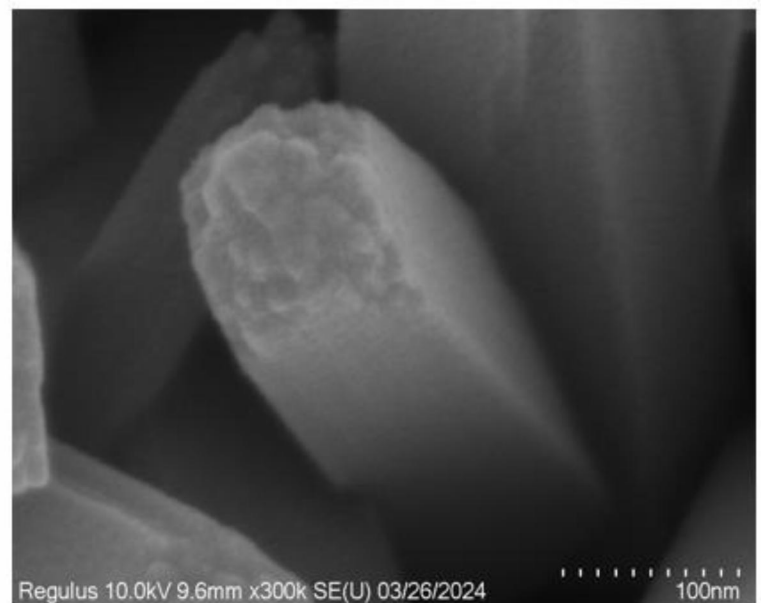
檢測服務

SEM：樣本表面之觀察及照相

EDS：原子序 6 以上之元素的全能譜。



拍攝樣品：TiO₂ 放大倍率：200K
拍攝者：黃柏維 (鄧熙聖老師實驗室)



拍攝樣品：TiO₂ 放大倍率：300K
拍攝者：黃柏維 (鄧熙聖老師實驗室)